

InfoPRO2012 発表 A25
(10月19日 16:30～16:55)

ロシア特許調査におけるデータベース の現状と問題点

都築 泉(大阪工業大学)

中西昌弘(オリンパスメディカルシステムズ)

太細博利(昭和シェル石油)

安藤俊幸(花王)

目次

1. ロシア特許制度
2. ロシア特許を収録する商用DB例と特徴
3. ロシア特許庁サイト
4. ロシア特許収録比較 - 書誌、抄録
5. ロシア特許庁DB 利用上の問題例
6. ロシア特許出願の動向

1. ロシア特許制度-1/2

1. ロシア出願の出願(特許取得)ルート

(1) パリルート

- ① ロシア特許庁への直接出願
- ② ユーラシア特許庁への出願
(ユーラシア特許(ロシアを含む広域特許)として取得)

(2) PCTルート

- ① PCT出願⇒ロシアへの国内移行
- ② PCT出願⇒ユーラシア特許庁への国内移行
(ユーラシア特許(ロシアを含む広域特許)として取得)

2. 出願後の各種手続き

(1) 新規性調査

新規性の調査を請求可能
新規性調査報告書が出願人に送付される

(2) 審査請求(実体審査)

出願日から3年以内
出願人または第三者による請求が可能

ロシア特許制度-2/2

3. その他

(1) 出願公開制度

出願日から18月経過後に公開される。
早期公開制度あり。

(2) 特許要件

産業上の利用可能性、新規性(世界公知)、
進歩性、公序良俗

新規性喪失例外規定(6月のグレース・ピリオド)あり

(3) 特許権

年金は毎年支払い

(4) 実用新案制度

進歩性は要件ではない。
実体審査なし

2. ロシア特許収録 - 調査対象DB

- ロシア特許庁DB(原語、英語)
- Shareresearch
- JP-Net
- DWPI(Thomson Innovation, Dialog)
- PatBase
- INPADOC(Dialog)
- FAMPAT(Orbit.com)

3. ロシア特許庁サイト

eng: 英語
画面へ

ロシア語画面: http://www.rupto.ru/en_site/

英語画面: http://www.rupto.ru/en_site/index_en.htm

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)

FEDERAL SERVICE FOR INTELLECTUAL PROPERTY (Rospatent)

Внимание! Роспатент проводит м... услуг, связанных с экспертизой э... анкеты

11 октября 2012

05 октября 2012

03 октября 2012

03 октября 2012

03 октября 2012

28 сентября 2012

28 сентября 2012

28 сентября 2012

28 сентября 2012

rus ABOUT ROSPATENT POLICY & LAW NEWS PRODUCTS AND SERVICES

Information products and services

- Official Publications of Rospatent
 - ["Inventions, Utility models"](#)
 - ["Trademarks, service maryks, appellations of origin"](#)
 - ["Industrial designs"](#)
 - ["Computer programs, Databases, Topographies of integrated circuits"](#)
- Publications of FIPS based on Officail Information of Rospatent
 - [Inventions](#)
 - [Utility models \(full specifications\)](#)
 - [Utility models \(Russian first page\)](#)
 - [Collection of Trademarks](#)
 - [Collection of Industrial designs](#)
- [Regional CD of the CIS Member States \(CISPATENT\)](#)
- [Internet Databases](#)

-----<<中略>>-----

[Internet Databases](#)

The Federal Institute of Industrial Property (FIPS) of ROSPATENT offers access through INTERNET to [databases of Russian inventions, utility models, trademarks and industrial designs.](#)

Username, Passwordに“guest”と入力

- Home
- NEWS
- ABOUT FIPS
- POLICY & LAW
- PATENT ATTORNEYS
- INTERNATIONAL COOPERATION
- SCIENTIFIC CONFERENCES
- PATENT INFORMATION PRODUCTS
- INFORMATIONAL RESOURCES
- Information Retrieval System**
- Open Registers
- Electronic bulletins
- Classifications
- CONTACTS

- Home
- NEWS
- ABOUT FIPS
- POLICY & LAW
- PATENT ATTORNEYS
- INTERNATIONAL COOPERATION
- SCIENTIFIC CONFERENCES
- PATENT INFORMATION PRODUCTS
- INFORMATIONAL RESOURCES
- Information Retrieval System
 - Services
 - Databases
 - User's Guide
- Open Registers
- Electronic bulletins
- Classifications

Information Retrieval System

For an entrance in free-of-charge DB the password and user's name is **guest**

Username:

Password:

Поисковый запрос

- ВЫБОР БД ДЛЯ ПОИСКА
- поиск
- найденные документы
- документ
- настройки
- статистика
- выход

Вид поиска: логический

Поиск

Основная область запроса

(54) Title biosensor

(11) Number

(45) Date of publication

(21) Application

(51) МПК (IPC)

(71) Applicant(s)

(72) Inventor(s)

(73) Proprietor(s)

(43) Application published

(85) Commencement of national phase

(86) PCT application

(87) PCT publication

(98) Mail address

(74) Representative

(56) The documents cited in search report

(30) Priority

(13) Type document

Поиск

Information Retrieval SystemをクリックするとID,PWの入力画面が開く

検索画面

ロシア特許収録件数調査結果例

DB 発行国	A社 RU 書誌 (SUも含む)					
	登録(B)	登録 (B)%	公開(A)	公開 (A)%	実案(Y)	実案(Y)%
1994年発行	3055	14%	0		1	1%
1995年発行	10258	39%	5	0%	7	1%
1996年発行	14921	76%	39	0%	23	1%
1997年発行	25004	84%	10	0%	21	1%
1998年発行	22635	97%	10	0%	76	2%
1999年発行	19452	100%	48	0%	112	3%
2000年発行	17552	100%	80	1%	814	20%
2001年発行	14302	88%	142	1%	1682	35%
2002年発行	18108	100%	246	2%	2688	48%
2003年発行	24710	100%	1722	7%	4679	56%
2004年発行	23131	100%	11744	37%	4802	61%
2005年発行	26291	112%	26284	100%	7242	100%
2006年発行	25825	111%	21288	100%	9573	100%
2007年発行	23431	102%	14529	96%	9761	100%
2008年発行	29070	101%	17430	73%	7368	76%
2009年発行	34957	100%	23286	100%	10922	100%
2010年発行	30416	100%	23251	100%	10582	100%
2011年発行	30089	100%	21778	100%	11081	100%

特許庁DBの
収録件数を
基準に、商用
DBの収録率
(%)を調査

調査日:2012.7.24

ロシア特許収録件数調査結果例

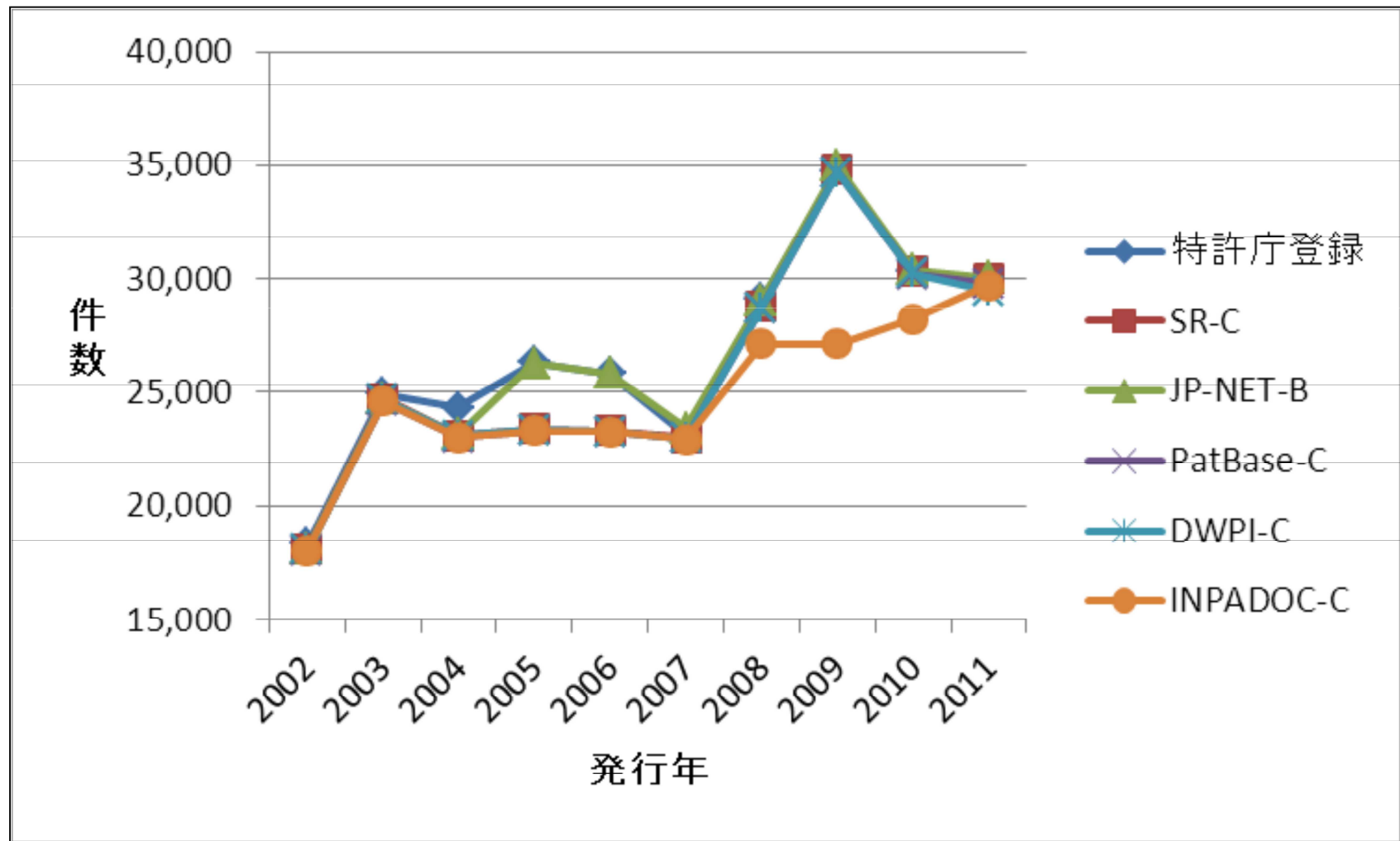
DB 発行国	C社						
	RU(ファミリー単位)						
公報種別	RU	登録(C)	登録(C)%	公開(A)	公開(A)%	実案(U)	実案(U)%
1994年発行	21475	20578	96%				
1995年発行	26300	25042	94%				
1996年発行	18890	18826	96%				
1997年発行	28682	28678	97%				
1998年発行	23302	23299	100%				
1999年発行	19472	19468	100%				
2000年発行	17562	17562	100%				
2001年発行	16258	16258	100%				
2002年発行	18094	18094	100%				
2003年発行	24680	24680	100%				
2004年発行	23087	23087	100%				
2005年発行	23354	23354	100%	3	0%		
2006年発行	23310	23310	100%	5	0%		
2007年発行	23059	23059	100%	6	0%		
2008年発行	28788	28788	100%	26	0%		
2009年発行	34712	34712	100%	209	1%	1	0%
2010年発行	57137	38854	128%	21980	95%	9838	93%
2011年発行	57042	34597	115%	26406	121%	10792	97%
2012年発行	30324	20263		15158		4051	

レコードがファミリー単位

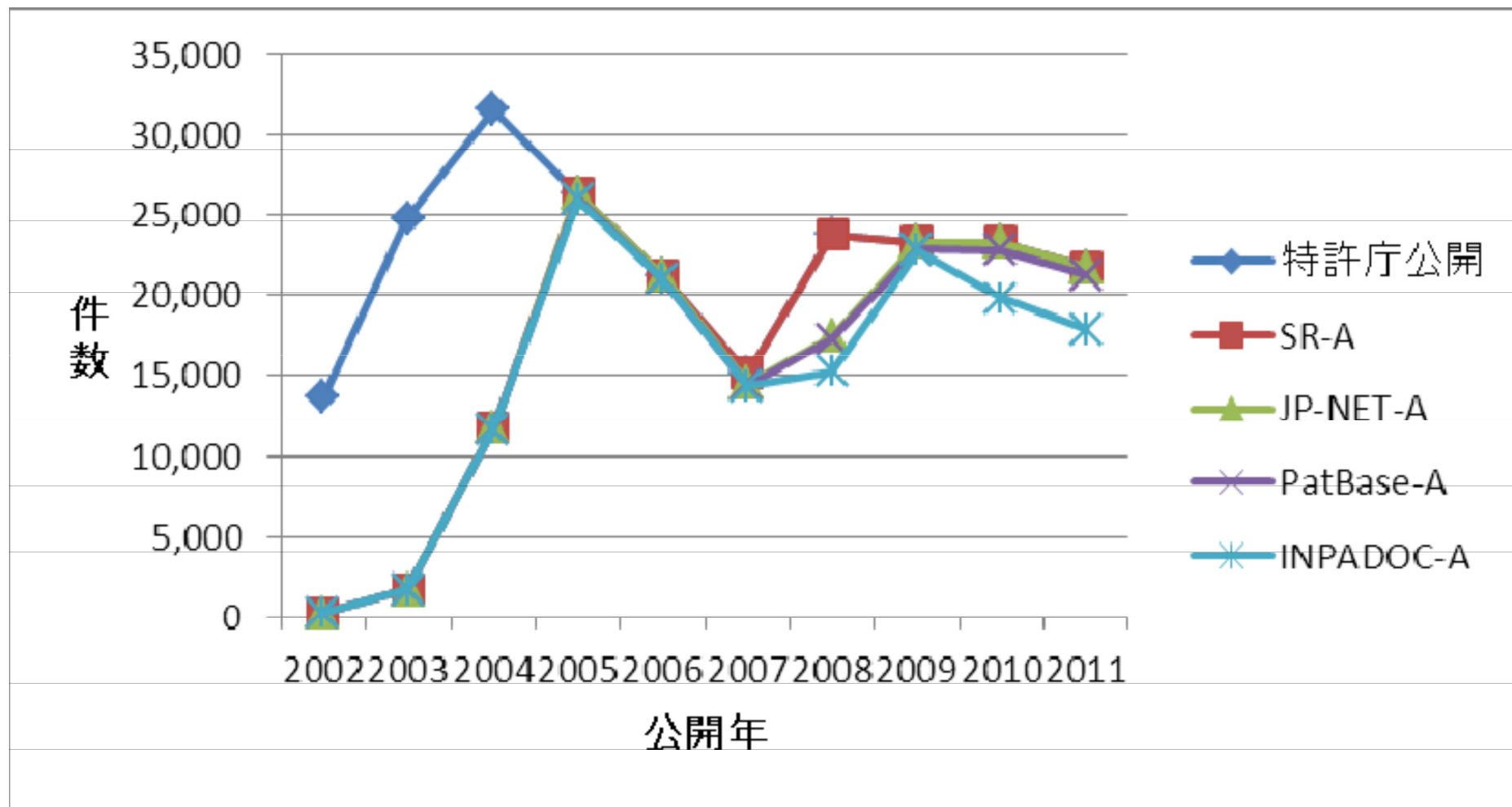
特許庁DBの収録件数を基準に、商用DBの収録率(%)を調査

調査日:2012.10.14

ロシア登録特許の件数



ロシア公開特許の件数



B社データベース書誌と要約の収録率

発行国	公報収録			
	RU			SU
公報種別	C公報	A公報	U公報	A公報
1994年発行	101%		1%	95%
1995年発行	100%	0%	1%	100%
1996年発行	99%	0%	1%	100%
1997年発行	97%	0%	1%	100%
1998年発行	100%	0%	2%	101%
1999年発行	100%	0%	3%	2%
2000年発行	100%	1%	100%	0%
2001年発行	100%	1%	100%	1%
2002年発行	100%	2%	100%	1%
2003年発行	100%	7%	100%	1%
2004年発行	100%	37%	100%	4%
2005年発行	100%	100%	100%	100%
2006年発行	100%	100%	100%	100%
2007年発行	100%	100%	100%	105%
2008年発行	100%	100%	100%	94%
2009年発行	100%	100%	100%	100%
2010年発行	100%	100%	100%	100%
2011年発行	100%	100%	100%	99%
2012年発行				

要約収録率			
RU			SU
C公報	A公報	U公報	A公報
98%	--	0%	70%
98%	20%	0%	76%
99%	74%	0%	85%
99%	70%	0%	100%
100%	50%	0%	99%
100%	75%	1%	78%
100%	84%	0%	0%
100%	73%	0%	0%
100%	52%	0%	33%
100%	33%	0%	0%
100%	73%	1%	0%
100%	84%	1%	2%
100%	81%	1%	21%
100%	71%	1%	58%
100%	80%	1%	30%
100%	82%	100%	52%
100%	82%	100%	17%
100%	76%	100%	5%
100%	66%	54%	11%

調査日:2012.10.15、2012.8.10まで収録要約収録チェック:com* con* dis* hav* inc* int* lea* met* one*
par* pre* pro* res* cha* rel* kin* arr*

F社データベース書誌と抄録の収録率

	公報収録		
	F社(ファミリー単位)		
発行国	RU	RU	SU
公報種別	登録(C+) 書誌%	公開(A+) 書誌%	SUA+ 書誌%
2000年発行	100%	1%	0%
2001年発行	100%	1%	1%
2002年発行	100%	2%	1%
2003年発行	100%	7%	1%
2004年発行	100%	37%	4%
2005年発行	100%	99%	100%
2006年発行	100%	100%	100%
2007年発行	100%	96%	105%
2008年発行	100%	73%	94%
2009年発行	100%	99%	100%
2010年発行	100%	99%	98%
2011年発行	100%	99%	99%
2012年発行			

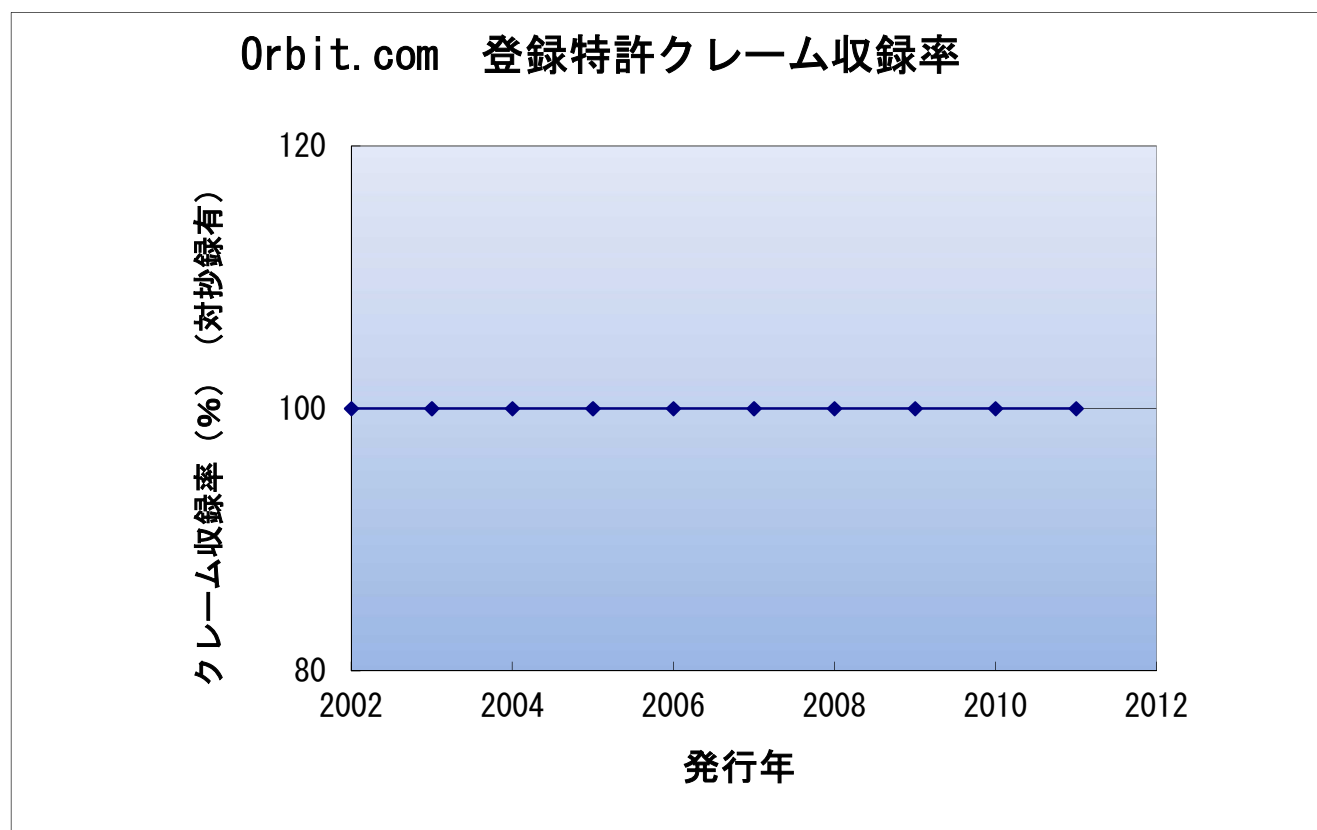
	抄録収録率		
	F社(ファミリー単位)		
	RU	RU	SU
	登録(C+) 抄録%	公開(A+) 抄録%	SUA+ 抄録%
	100%	85%	0%
	100%	73%	25%
	100%	53%	33%
	100%	33%	0%
	100%	74%	0%
	100%	84%	2%
	100%	82%	21%
	100%	76%	58%
	100%	82%	30%
	100%	86%	80%
	100%	83%	17%
	100%	77%	5%
	100%	70%	11%

収録比較のまとめ

- 2005年以降の登録特許の収録率は高い
- 抄録の収録に関しては、公報単位のDBとファミリー単位のDBでは、一概に比較できない

参考：ロシア登録特許 クレーム収録率(2002年～2011年)の例

Orbit.com(FAMPAT)



2002～2011年発行の登録特許につき、ロシア特許のクレームの収録状況を確認

⇒要約があるものの全てがクレーム

(注)公開特許については、DB側のデータ集積中とのこと

確認方法

各n=10を目視確認

2012.10.14確認

5. ロシア特許庁DB利用上の問題

5.1 検索結果が200件以上の場合、件数・結果が表示されない。

⇒「出願日」・「(43)公開発行日」・「(45)発行日」のフィールドを利用して検索母集団を分割する。

※「出願日」フィールドはウインドウ左側の「НАСТРОЙКИ(SETTING)」メニューを操作し、検索フィールドとして追加が必要。

5.2 長い出願人名表記、表記の揺れ・ミススペル

5.3 扱いにくい言語

5.2 ロシア特許庁DBの問題への解決手段 ～長い出願人名表記～

ロシア特許出願人

下記はRU特許庁ロシア語DBより取得したRU2316281C2の出願人名。

Ф е д е р а л ь н о е г о с у д а р с т в е н н о е
у ч р е ж д е н и е “ С а р а т о в с к и й н а у ч н о -
и с с л е д о в а т е л ь с к и й и н с т и т у т
т р а в м а т о л о г и и и о р т о п е д и и
Ф е д е р а л ь н о г о а г е н т с т в а п о
в ы с о к о т е х н о л о г и ч н о й м е д и ц и н с к о й
п о м о щ и ” (Ф Г У “ С а р Н И И Т О
Р о с м е д т е х н о л о г и й ”)

ロシア語を読めない日本人には単なる記号の羅列。

5.2 ロシア特許庁DBの問題への解決手段 ～長い出願人名表記～

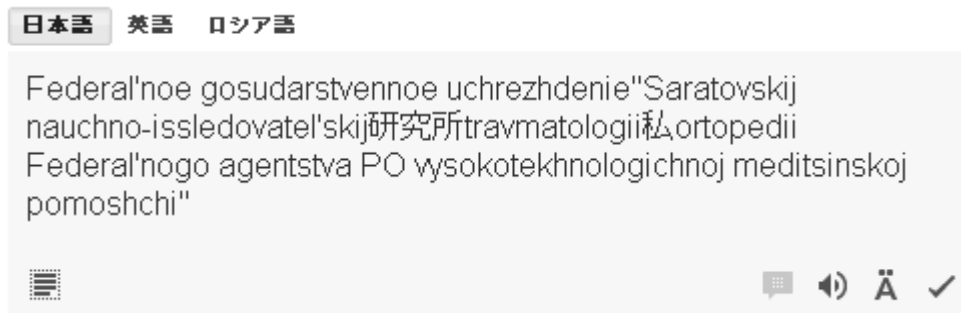
ロシア特許出願人

そこでRU特許庁の英語DBから出願人名を取得すると

Federal'noe gosudarstvennoe uchrezhdenie "Saratovskij nauchno-issledovatel'skij institut travmatologii i ortopedii Federal'nogo agentstva po vysokotekhnologichnoj meditsinskoj pomoshchi"

記号の羅列が、見覚えのある文字の羅列に代わっただけで、見覚えのある単語は出現しない。これは、「英語」ではなくロシア語の発音をアルファベットに置き換えた「英語風文字列」であり、いわゆる日本で言うところのローマ字、中国のピンイン表記と同じ。

この文字列をGoogle翻訳(英→日)させても、まったく意味不明。



5.2 ロシア特許庁DBの問題への解決手段 ～長い出願人名表記～

ロシア特許出願人

DOCDBの元情報もこの「英語風文字列」であり、espacenetでRU2316281C2を検索すると

Bibliographic data: RU2316281 (C2) — 2008-02-10

★ In my patents list ↗ EP Register → Report data error

 Print

METHOD FOR EXTRAARTICULAR CORRECTION OF KNEE JOINT DEFORMATIONS

Page bookmark [RU2316281 \(C2\) - METHOD FOR EXTRAARTICULAR CORRECTION OF KNEE JOINT DEFORMATIONS](#)

Inventor(s): TSAREVA EKATERINA EVGEN EVNA [RU]; KURKIN SERGEJ ALEKSEEVICH [RU]; VINOKUROV VJACHESLAV ALEKSANDR [RU]; NORKIN IGOR ALEKSEEVICH [RU] ±

Applicant(s): FEDERAL NOE G UCHREZHDENIE SAR [RU] ±

のように、より情報量が減少する結果に(出願人名が長いため省略して表記)。

5.2 ロシア特許庁DBの問題への解決手段 ～長い出願人名表記～

ロシア特許出願人

出願人名を把握するための推奨方法は、ロシア語文字列をそのままGoogleで翻訳する方法。日本語と英語の双方に翻訳することで、理解可能な文字列へと変態を遂げる。

The screenshot displays the Google Translate interface. On the left, the Russian text is entered: "Федеральное государственное учреждение "Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" (ФГУ "СарНИИТО Росмедтехнологий")". The interface is set to translate from Russian to Japanese. On the right, the Japanese translation is shown: "連邦国家機関 "外傷と整形外科のサラトフ科学研究所、ハイテクヘルスケアのための連邦機関" (FGU "SarNIITO 整形外科")". Below this, the English translation is displayed: "Federal State Institution "Saratov Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopedics, the Federal Agency for high-tech health care" (FGU "SarNIITO Orthopedics")". The interface also shows language selection buttons for Russian, English, and Chinese, and a checkbox for "Use voice input based on pronunciation".

出願人名は「外傷・整形外科サラトフ科学研究所(仮称)」と判明。

5.2 ロシア特許庁DBの問題への解決手段 ～長い出願人名表記～

ロシア特許出願人

ロシアでは、まだ民間企業からよりも政府機関・公立大学等からの出願が多く、前例のように出願人名が非常に長く、表記の揺れ・ミススペルが目立つ。

下記はいずれも「外傷・整形外科サラトフ科学研究所」。

С а р а т о в с к и й н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и й
и н с т и т у т т р а в м а т о л о г и и и о р т о п е д и и ,
М и н и с т е р с т в о з д р а в о о х р а н е н и я Р Ф

Ф Г У “ С а р а т о в с к и й н а у ч н о -
и с с л е д о в а т е л ь с к и й и н с т и т у т
т р а в м а т о л о г и и и о р т о п е д и и Р о с з д р а в а ”
(С а р Н И И Т О)

Г У “ С а р а т о в с к и й н а у ч н о -
и с с л е д о в а т е л ь с к и й и н с т и т у т
т р а в м а т о л о г и и и о р т о п е д и и ” (С а р Н И И Т О)

これらを外部で名寄せすることで出願人ごとのポートフォリオが把握できる。²²

ロシア機関のDWPI出願人コードと出願人の統制

「外傷・整形外科サラトフ科学研究所」のDWPI出願人コード: **SPET-R**

RU2316281C2のDWPI 譲受人 / 出願人

ST PETERSBURG EAR THROAT SPEECH RES INST, **SPET-R**

R: 非標準 (ロシア・ソ連機関)

(出願人コードの末尾に「-R」をつけないと標準コードとして処理される)

DWPI出願人コードの検索で「SPET-R」の出願人異表記を参照すると
568の異表記を表示。

DWPI出願人コード「SPET-R」で検索 3583件ヒット (Thomson Innovation)
ロシアの公報番号を抽出してOrbit.comで番号検索 3136件 (ファミリー)
Orbit.com ノーマライズ出願人 (NPA: 英語) のランキング 計**917** (共願人も含む)
Orbit.com オリジナル出願人 (PA0: 原語) のランキング 計**960** (共願人も含む)

DWPI出願人コードは有用ではあるが万能ではない
ロシアの出願人の統制には多大な根気・忍耐が必要

参考) DWPI出願人コード

<http://ip-science.thomsonreuters.jp/products/dwpi/support/AssigneeCode/>

5.3 原語の問題

- 扱い易い商用DBで、ロシア特許をより深く検索することはできるか？
→ロシア語（及び機械翻訳英語）でクレーム以下も検索、表示できるDBもある！



解決手段: 英語の抄録を収録するDBの利用

例: Orbit.com クレーム以下もロシア語、機械翻訳英語の収録もあり

Orbit.com search results for patent RU2010146348 A. The page displays the patent title, abstract, and other related information.

(C1) STRUCTURE AND METHOD OF MAKING INTEGRATED FIELD-EMISSION ELEMENTS HAVING NANODIAMOND COATING-BASED EMITTERS

Abstract
 FIELD: physics. ^ SUBSTANCE: invention relates to electronics and can be used in making vacuum microelectronic devices. The essence of the invention lies in that the integrated field-emission element has a substrate coated with a dielectric layer, a cathode structure consisting of one or more layers of electroconductive material and lying on the outer surface of said substrate, a support structure lying on the top surface of said cathode structure and having through-holes inside of which cathodes are formed based on nanodiamond coatings, lying on the outer surface of the cathode structure, an anode layer made from electroconductive material lying on the outer surface of said support structure and having working holes superimposed with said holes in the support structure. The nanodiamond coating-based emitter is made in a single process cycle with formation of anode structures without a further process of superimposing the anodes with the cathode structure. ^ EFFECT: use of nanodiamond coatings as emitter material, said coatings being carbon films containing nanostructured diamond components, which results in higher resistance to disintegration, current density and low operating voltage in integrated vacuum nano- and microelectronic devices. * 4 cl, 8 dwg

Other Abstracts
 Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при изготовлении приборов вакуумной микроэлектроники. Техническим результатом изобретения является использование в качестве материала эмиттера нанодIAMONДНЫХ покрытий, представляющих собой углеродные пленки, которые содержат наноструктурированные алмазные компоненты, что приводит к повышению деградационной стойкости, плотности тока и уменьшению рабочих напряжений в интегральных приборах вакуумной нано- и микроэлектроники. Сущность изобретения: интегральный автоэмиссионный элемент включает подложку, покрытую диэлектрическим слоем, катодную структуру, состоящую из одного или нескольких слоев электропроводящего материала и расположенную на внешней поверхности упомянутой подложки, опорную структуру, расположенную на верхней поверхности упомянутой

Orbit.com search results for patent RU2010146348 A. The page displays the patent title, abstract, and other related information.

1 / 161 - 特許ファミリー

RU2010146348 A
 RU2455724 C1

類似検索
 Inpadocファミリーを検索
 Inpadocファミリーのグラフ化

Claims
 Claims machine translated from Russian
 1. The integral field emission element, which contains the base layer, the cathodic structure, which consists of one either several layers of the electrically conducting material and located on the outer side mentioned dielectric base layer, the support structure, which consists of one dielectric layer or several dielectric or electrically conducting layers, located on the external surface of the mentioned cathodic structure and containing open-end holes for shaping of emissive cathodes on the basis of the nano-diamond coatings, located in the mentioned openings of support structure on the external surface of cathodic structure, the anodic layer of the electrically conducting material, situated on the external surface of the mentioned support structure and which contains the technological openings, combined with the mentioned openings in the support structure, that is characterized by the fact that the creation of emitter on the basis of nano-diamond coating is conducted in the common technological cycle with the forming of the structure of the anodes without the additional operation of the combination of the anodes with the cathodic structure with shaping of the operating regions of the elements in the form of grooves, deposition of nano-diamond coating to the surface of structures and on the bottom of grooves, putting and the plasma-chemical etching of photoresist with closing of the bottom of grooves, the plasma-chemical etching of nano-diamond coating from

Orbit.com search results for patent RU2010146348 A. The page displays the patent title, abstract, and other related information.

1 / 161 - 特許ファミリー

RU2010146348 A
 RU2455724 C1

類似検索
 Inpadocファミリーを検索
 Inpadocファミリーのグラフ化

of grooves, putting and the plasma-chemical etching of photoresist with closing of the bottom of grooves, the plasma-chemical etching of nano-diamond coating from the surface, not closed with photoresist, the liquid chemical etching of photoresist on the bottom of grooves.

Original Claims
 1. Интегральный автоэмиссионный элемент, содержащий подложку, катодную структуру, состоящую из одного или нескольких слоев электропроводящего материала и расположенной на внешней стороне упомянутой диэлектрической подложки, опорную структуру, состоящую из одного диэлектрического слоя или нескольких диэлектрических или электропроводящих слоев, расположенную на внешней поверхности упомянутой катодной структуры и содержащую сквозные отверстия для формирования эмиссионных катодов на основе нанодIAMONДНЫХ покрытий, расположенных в упомянутых отверстиях опорной структуры на внешней поверхности катодной структуры, анодный слой из электропроводящего материала, расположенный на внешней поверхности упомянутой опорной структуры и содержащий технологические отверстия, совмещенные с упомянутыми отверстиями в опорной структуре, отличающийся тем, что создание эмиттера на основе нанодIAMONДНОГО покрытия проводится в едином технологическом цикле с формированием структуры анодов без

まだ登録特許をメインにデータ集積中の模様であるが、クレーム以下をロシア語及び機械翻訳英語で検索、表示できる意義は大きい。

解決手段：英語の抄録を収録するDBの利用

例：PatBase ロシア語特許収録の例

WO12039645 A2 Translate via PatBase internal translation: Translate via Google:

Title :
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕМБРАННОГО ФИЛЬТРА

Abstract :

Изобретение относится к микроструктурным технологиям и может использоваться в нанотехнологии, медицине, химии, молекулярной биологии, оптике. Мембранный фильтр получают путем облучения полимерной пленки в среде водорода синхротронным излучением в диапазоне длин волн 5+100 нм, структурированным с помощью системы решеточной интерференционной литографии. Технический результат состоит в получении мембранного фильтра с пористостью до 0.6, с упорядоченным расположением пор одинакового размера (от 1 нм и больше), круглых или эллиптических в поперечном и конических в продольном сечении. Дополнительными техническими результатами являются возможности получения, применяя предлагаемый способ в комбинации с элементами технологий микроэлектроники или ЛИГА, мембранного фильтра из пленки толщиной менее 100 нм из или полимерного, или неорганического материала, в том числе из металла, армированного или кремниевой, или металлической микропористой структурой. Дополнительный технический результат может также состоять в формировании предлагаемым способом нанопористой упорядоченной структуры поверхности имплантанта, имеющей большое значение для его успешной интеграции в соединительную или костную ткань.

Claim(s) :

ФОРМУЛА.

1170 Способ изготовления мембранного фильтра.

1.Способ изготовления мембранного фильтра с одинаковыми размерами и формой пор, включающий облучение полимерной пленки излучением, вызывающим локальную химическую деструкцию материала полимерной пленки, и травление (удаление) продуктов деструкции материала облученных участков полимерной пленки, чем

1 175 обеспечивается формирование пор в полимерной пленке,

отличающийся тем,

что облучение полимерной пленки производят синхротронным излучением, структурно упорядоченным с помощью системы многолучевой решеточной интерференционной литографии, в камере, заполненной газообразным водородом, вступающим на

1180 облучаемых участках полимерной пленки в фотохимическую реакцию с материалом полимерной пленки с образованием летучих продуктов, удаляемых во время

現時点ではデータ集積中の段階のようであるが、例として、PCT特許のロシア語クレームの例を示す。

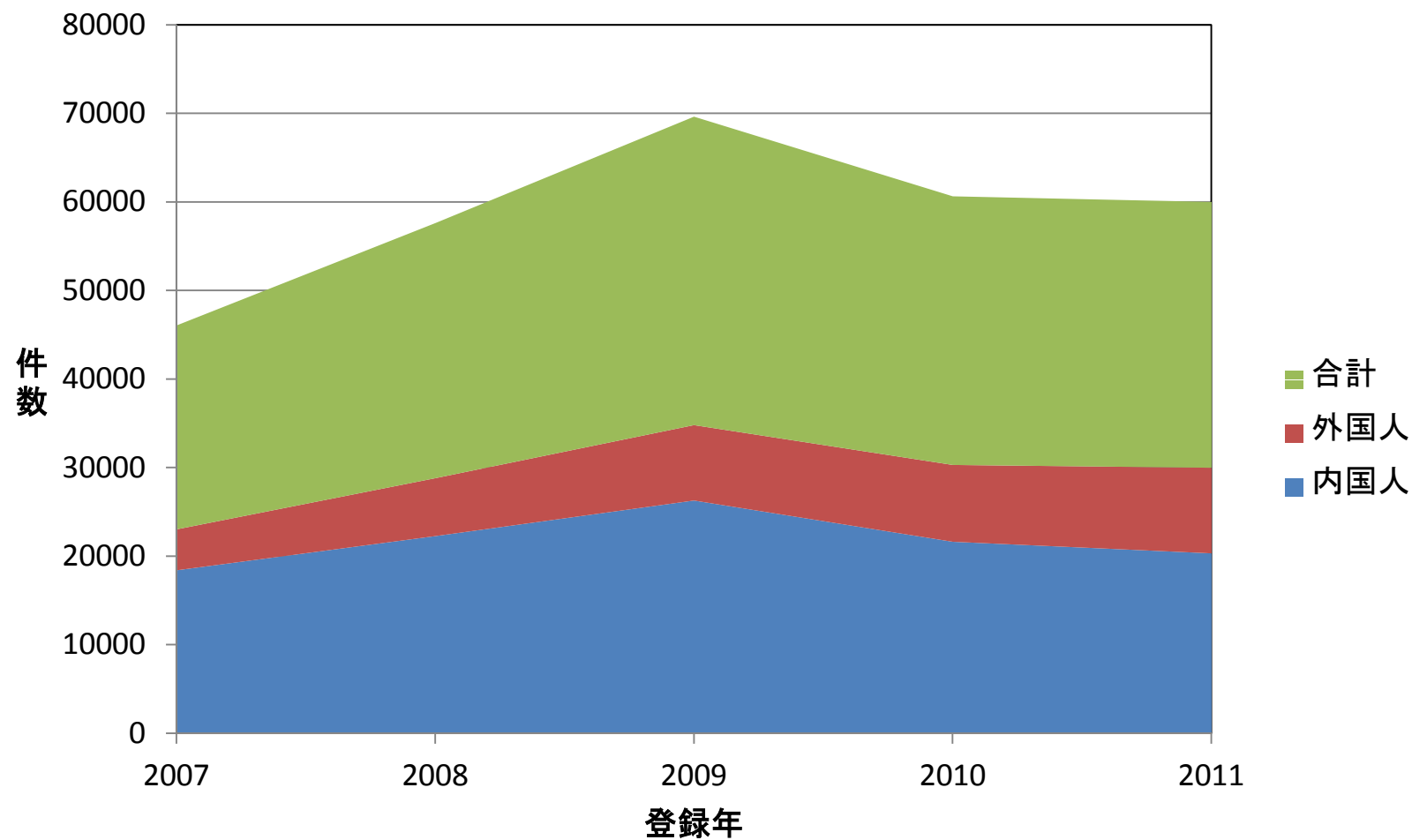
例：ФОТОРЕЗИСТА
(フォトレジスト)で検索した例

5.3 原語の問題 まとめ

- ロシア特許については、要約までしか検索できなかったが、ロシア語及び機械翻訳英語で検索及び表示できるDBも登場し、今後のさらなる収録改善、機能向上が期待される。

6. ロシア特許の出願動向

内国人と外国人の特許登録の割合



ロシア特許出願動向

PatBaseによる分析例

- IPC分析

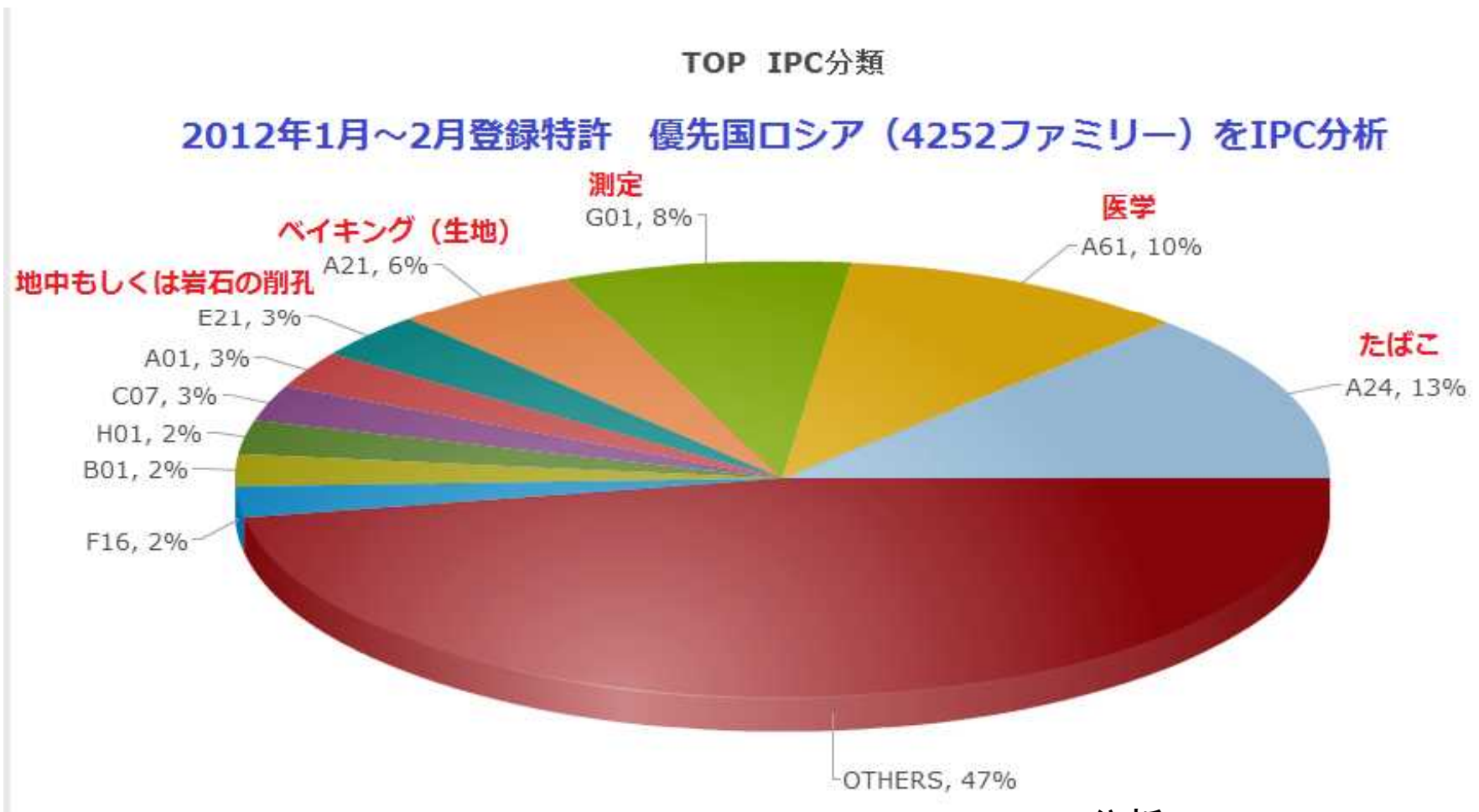
(PND=(RUC201201 or RUC201202)) and
(PRC=RU) →4252ファミリーをIPC分析

- 発明国分析

(PND=(RUC201201 or RUC201202 or
RUC201203 or RUC201204)) not (PRC=RU)
→2471ファミリーを発明国分析

ロシア内国人出願IPC分析

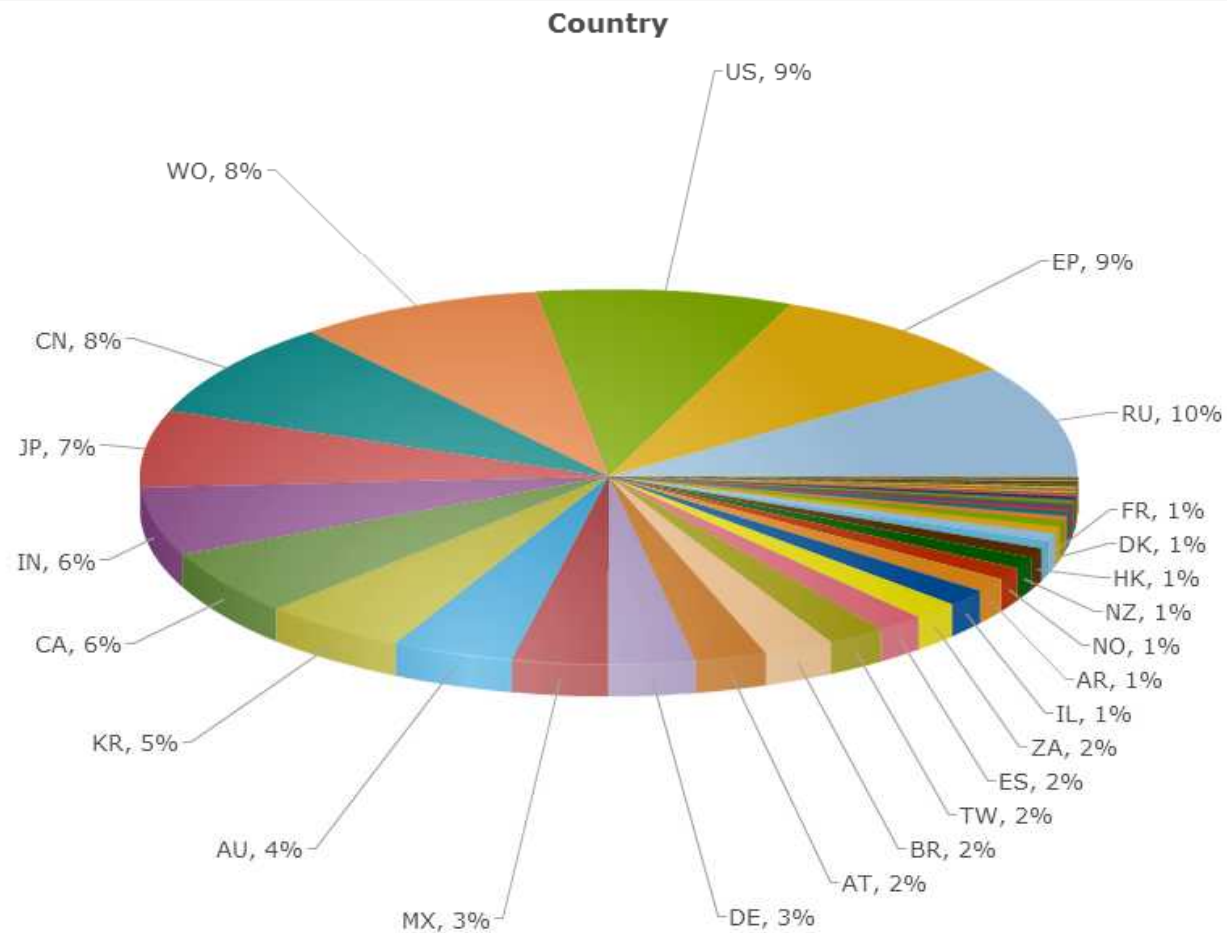
2012年1月～2月内国人登録特許を分析



分析DB:PatBase

ロシア外国人出願発行国

2012年1月～4月外国人特許を分析



最後に：対ロシアへの企業戦略 と知財情報調査

- ロシアと日本の貿易は順調に伸びている
(JETRO等のデータより)
- 今後の経済活動の基盤としても、注目すべき
- 扱いにくいロシア語という言語であるが、英語を収録するデータベースもあり、2005年以降は比較的収録率も良くなっている。
- 今後のさらなる情報の充実が望まれる。